

97-2 大葉大學 選課版課綱

基本資訊

課程名稱	半導體製程設備與實習	科目序號 / 代號	1753 / EEI4214
開課系所	電機工程學系	學制 / 班級	大學日間部4年1班
任課教師	李世鴻	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(四)12 / H203 (五)3 / H355	授課語言別	中文

課程簡介

使學生瞭解超大型積體電路製程中所使用的各種設備、運作原理及技術

課程大綱

1.基礎真空概論與技術、2.電漿、3.潔淨室、4.化學氣體、5.各種薄膜沉積設備、6.熱氧化技術與設備、7.蝕刻技術與設備、8.光石刻技術與設備、9.選擇性摻雜技術與設備。

基本能力或先修課程

固態電子學